

10 Rec'd USPTO 25 JUN 2004

## 特許協力条約

PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

RECEIVED
22 JAN 2004
WIPO PCT

出願人又は代理人 の書類記号 137323-875	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP02/09512	国際出願日 (日.月.年) 17.09.2002	優先日 (日.月.年) 27.12.2001
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' H01L21/205, H01L21/22, C23C16/458, C23C16/46, H01L21/68		
出願人（氏名又は名称） 東京エレクトロン株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関に対して訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)

この附属書類は、全部で 2 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I  国際予備審査報告の基礎
- II  優先権
- III  新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV  発明の単一性の欠如
- V  PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI  ある種の引用文献
- VII  国際出願の不備
- VIII  国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 14.04.2003	国際予備審査報告を作成した日 08.01.2004
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 加藤 浩一 電話番号 03-3581-1101 内線 3425
	4E 8617

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

 出願時の国際出願書類

<input checked="" type="checkbox"/> 明細書	第 <u>1 - 9</u>	ページ、	出願時に提出されたもの
明細書	第 _____	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書	第 _____	ページ、	付の書簡と共に提出されたもの
<input checked="" type="checkbox"/> 請求の範囲	第 <u>3, 6 - 13</u>	項、	出願時に提出されたもの
請求の範囲	第 _____	項、	PCT19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲	第 _____	項、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲	第 <u>1 - 2, 4 - 5</u>	項、	<u>29.08.2003</u> 付の書簡と共に提出されたもの
<input checked="" type="checkbox"/> 図面	第 <u>1 - 7</u>	ページ/図、	出願時に提出されたもの
図面	第 _____	ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面	第 _____	ページ/図、	付の書簡と共に提出されたもの
<input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分	第 _____	ページ、	出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分	第 _____	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分	第 _____	ページ、	付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

國際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

この国際出願に含まれる書面による配列表  
 この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述  
 書の提出があった  
 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

## 4. 補正により、下記の書類が削除された。

明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5.  この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかつたものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

#### V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 <u>1-13</u> 請求の範囲 _____	有 無
進歩性 (IS)	請求の範囲 _____ 請求の範囲 <u>1-13</u>	有 無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-13</u> 請求の範囲 _____	有 無

## 2 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 11-260746 A(住友金属工業株式会社)1999.09.24  
文献2: WO 00/19502 A1(株式会社日立製作所)2000.04.06  
文献3: JP 11-097362 A(富士通株式会社)1999.04.09  
文献4: JP 2000-269150 A(東芝セラミックス株式会社)2000.09.29  
文献5: JP 10-050626 A(三井造船株式会社)1998.02.20図1  
文献6: WO 01/18856 A1(三菱マテリアルシリコン株式会社)2001.03.15  
文献7: JP 11-031639 A(国際電気株式会社)1999.02.02  
文献8: JP 9-237781 A(東京エレクトロン株式会社)1997.09.09

請求の範囲1-13に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1(請求項2、文  
請求項3、図1、図2)、文献2(請求項5、第7頁第6-7行、FIG4)と、文献1、2との持  
文献3(請求項1、図1)、文献5(図1)とにより進歩性を有しない。文献1、2を  
は、支持板は「ウェーハ挿入溝」、「溝」を介して支柱に取り付けられるが、ここ5支  
文献3のように「支持爪」を介して取り付けることは、当業者が適宜なし得た  
ある。一方、「支持爪」の側壁部に当接して滑落を防止する係止構造は、文献1  
1に記載されているように周知である。従って、文献1、2により教示された  
に、滑落を防止する係止部を設けることは当業者にとって容易である。

被処理体搭載面に、被処理体の張り付きを抑制するための微細な凹凸を設けることは周知（文献4の請求項4、【0021】、【0033】）の構成である。

部材に係止部あるいは係合孔を設けることは慣用（文献5の図1、文献6の図1、新たに引用する文献8の請求項3）されており、この点に進歩性は認められない。

また、熱処理用ポートの上端部及び下端部に複数のダミープレートを取り付けることは周知（文献7の請求項1、図1）の構成にすぎない。

### 請求の範囲

1. (補正後) 複数の支柱と、  
前記支柱の各々において、高さ方向に所定の間隔で形成された複数の爪部と、  
前記爪部を介して前記複数の支柱間に多段に取り付けられた、被処理体を搭載  
可能な被処理体搭載面を有する複数の支持板と、  
前記被処理体搭載面に設けられた溝及び貫通孔と、  
を備え、  
前記複数の支柱は、少なくとも前記支持板の左方及び右方に配置されており、  
前記支持板には、前記支持板の左方の支柱の爪部に係止されて当該支持板の滑  
落を防止する左係止部と、前記支持板の右方の支柱の爪部に係止されて当該支持  
板の滑落を防止する右係止部と、が設けられている  
ことを特徴とする熱処理用ポート。
2. (補正後) 前記被処理体搭載面には、被処理体の張り付きを抑制するた  
めの微細な凹凸が設けられている  
ことを特徴とする請求項1に記載の熱処理用ポート。
3. 前記支持板は略円形であり、  
前記複数の支柱は、前記支持板に垂直に、前記支持板の後方、左方及び右方に  
配置されている  
ことを特徴とする請求項1または2に記載の熱処理用ポート。
4. (補正後) 前記支持板は略円形であり、  
前記溝は、同心円状に設けられた複数の環状の溝であり、  
前記貫通孔は、各環状溝内において当該環状溝の周方向に所定の間隔で複数設  
けられた貫通孔である  
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の熱処理用ポート。

10/1

5. (補正後) 前記左係止部及び前記右係止部は、爪部の側壁部に当接する  
ストッパ部材である  
ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の熱処理用ポート。